آنالیز الگوی پراش پرتو ایکس لایه های نازک نانوساختار اکسید روی با استفاده از روش

ويليامسون-هال (W-H)

حبيبی، علی؛ نقش آرا، حميد؛ محمدی عارف، ساجده

دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز، بلوار ۲۹ بهمن-خیابان امام خمینی، تبریز

چکیدہ

لایه های نازک نانوساختار اکسید روی با استفاده از لایه نشانی فلز روی (Zn) خالص به روش کندوپاش مگنترونی روی زیر لایه ی کوارتز و بازپخت آن در دمای ثابت ^C ۲۰۰[°] و بازه زمانی متغیر یک، دو، سه، چهار و پنج ساعت تهیه شدند. جهت بررسی مشخصات ساختاری نانو ذرات اکسید روی، یک ارزیابی مقایسهای متوسط اندازه دانه های بدست آمده از اندازه گیری مستقیم میکروسکوپ الکترونی رویشی و تحلیل پهنای پیکهای، طیف پراش پرتو ایکس انجام گرفت. این لایه ام متوسط اندازه دانههای بدست آمده از اندازه گیری مستقیم میکروسکوپ الکترونی رویشی و تحلیل پهنای پیکهای، طیف پراش پرتو ایکس انجام گرفت. این لایه ما دارای ساختار بایری هگزاگونال ورتزایت می باشند. بررسی تصویر SEM نمونه بازپخت شده در مدت زمان یک ساعت نشان می دهد که این لایه دارای ساختار بلوری هگزاگونال ورتزایت می باشند. بررسی تصویر Med نمونه بازپخت شده در مدت زمان یک ساعت نشان می دهد که این لایه اساختار بلوری مشر گوشی(HCP) است. در حالی که در مورد بقیه لایههای نازک، تشکیل نانو ذرات کروی تایید می شود. اندازه شبکه با استفاده بازیک تشده در مدت زمان یک ساعت نشان می دهد که این لایه دارای ساختار بوری تشان می دهد که این لایه دارای ساختار بلوری شاخیر گوش گیده می شده می مند. بررسی تصویر Med نمونه بازیخت شده در مدت زمان یک ساعت نشان می دهد که این لایه دارای ساختار بلوری تنگ پکیده شش گوشی(HCP) است. در حالی که در مورد بقیه لایههای نازک، تشکیل نانو ذرات کروی تایید می شود. اندازه ذرات و کرنش شبکه با استفاده از تحلیل پهن شدگی و گسترش پیکهای نانو ذرات اکسید روی، با دو روش مختلف ویلیامسون-هال و شرر مطالعه شد. این نتایج با نتایج حاصل از تحلیل تصاویر SEM هم خوانی خوبی دارند.

X-ray diffraction analysis of zinc oxide nano-structure thin films using Williamson-Hall

method Habibi, Ali; Naghshara, Hamid; Mohammadi Aref, Sajedeh

Department of Physics, University of Tabriz, Tabriz, Iran

Abstract

Zn pure thin films were prepared by magnetron sputtering deposition on quartz substrate. Then, they were annealed at a temperature of 700°C and 5 different time intervals, i.e., 1h, 2h, 3h, 4h and 5h to form zinc oxide nano-structure thin films. To study the structural properties of ZnO nano particles, mean particle size was compared using both SEM micrographs and X-ray peak broadening analysis. These films have wurtzite crystal structure. Investigation of SEM micrograph of 1h- annealed layer reveals that this film has hcp crystal structure; while, formation of spherical nanoparticles is confirmed for the other thin films. Crystalline size and lattice strain were evaluated using X-ray peak broadening analysis of ZnO nano particles, using two different models suggested by Williamson-Hall and Scherrer, as well. Obtained results are in good agreement with that deduced from SEM analysis.

PACS No. 61.10

پیزوالکتریک است. اکسید روی یک نیم رسانای شفاف نوع n و یکی از مهم ترین نیم رساناهای ترکیب II و VI است که در مقایسه با سایر مواد نیم رسانا، انرژی پیوندی اکستیون بالاتری (۶۰ meV) دارد. گاف انرژی آن در دمای اتاق، حدود ۷۶ ۳/۳۷ می باشد که برای استفاده در اپتوالکتریک در طول موج های کوتاه مناسب است [۲]. اندازه ذرات و ریخت شناسی کریستال، نقش مهمی در کاربردهای گسترده اکسید روی دارند و دو پارامتر مهم

مقدمه

اکسید روی در طبیعت به صورت معدنی یافت می شود. در شرایط فشار و دمای اتاق، اکسید روی (ZnO) در ساختار شش گوشی ورتزایتی متبلور می شود. اتم های روی تقریبا در موقعیت تنگ پکیده شش گوشی (HCP) هستند [۱]. از آن جا که این ساختار تقارن مرکزی ندارد، اکسید روی به عنوان یک ماده منحصر به فرد معرفی می شود که دارای خواص دوگانه نیمه هادی و

برای اندازه گیری و شناسایی خواص فیزیکی نانو ذرات هستند که تحت تاثير روش توليد و سنتز مي باشند [٣]. تغييرات ریزساختاری بر شدت و پهنای پیک های پراش پرتو ایکس تاثیرگذار است. هم چنین تغییر کسر حجمی فازهای موجود در ریزساختار تغییراتی را در شکل تابع شدت پیک ایجاد می نماید. از این رو تعیین تابع شدت پیک و مطالعه ی تغییرات آن، اطلاعات مفيد و موثري از ريزساختار مواد به دست مي دهد [۴]. تجزيه وتحلیل الگوهای پراش پرتو ایکس، یک ابزار ساده و در عین حال قوى جهت تخمين اندازه دانه و كرنش شبكه است [۵]. رايج ترين تکنیک های مورد استفاده برای اندازه گیری اندازه ذرات به جای اندازه دانه عبارتند از آنالیز پراکنش نور، میکروسکوپ الکترونی روبشى (SEM)، ميكروسكوپ الكتروني عبوري (TEM). كرنش شبکه از توزیع ثابت شبکه ناشی از عیوب کریستالی، مانند جابجاشدگی شبکه، تماس و یا عیوب مرزدانه و نابجایی پیچشی ، اندازه گیری می شود [۶و۷]. ویلیامسون و هال، اندازه دانه و کرنش های درون شبکه ای را عامل پهن شدگی پیک های حاصل از پراش پرتو ایکس معرفی کردند [۸]. براساس تئوری ارائه شده توسط ويليامسون- هال عرض پيک در نصف شدت بيشينه تابعي از اندازه دانه و همچنین کرنش های درون شبکه ای است. در مطالعه حاضر با بررسی طیف پراش پرتو ایکس لایه های نازک اکسید روی تهیه شده به روش کندوپاش مگنترونی روی خالص (Zn) و باز پخت آن ها، یک ارزیابی مقایسه ای بین اندازه متوسط دانه ها انجام گرفته است. هم چنین روش ویلیامسون- هال برای تجزیه و تحلیل اندازه دانه و کرنش شبکه استفاده شده است.

مواد و روش ها

به جهت بالا بودن دمای بازیخت، از زیرلایه کوارتز استفاده شد. پس از تمیز کردن کامل زیرلایه، لایه نازکی از روی با خلوص MECA-2000٪ با استفاده از دستگاه کندوپاش مگنترونی MECA-2000 ساخت کشور فرانسه، به ضخامت ۱۰۰۰ آنگستروم با نرخ لایه نشانی ۱/۵ آنگستروم بر ثانیه و فشار کاری ^۳-۱۰ میلی بار تهیه گردید. لایه ی نازک تهیه شده در دمای ثابت C° ۷۰۰ و بازه زمانی متغیر یک، دو، سه، چهار و پنج ساعت تحت بازیخت قرار

گرفت. در نهایت خواص ساختاری نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. برای داشتن الگوهای پراش اشعه ایکس از دستگاه D500 ساخت کشور آلمان با طول موج λ۶۰۴/۴ آنگستروم استفاده شد. تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM توسط دستگاه MIRA3 TESCAN صورت گرفت. هم چنین روش ویلیامسون- هال برای تجزیه و تحلیل اندازه دانه و کرنش شبکه استفاده شده است.

نتايج و بحث

آ**نالیز طیف سنجی XRD**: بررسی طیف XRD لایه نازک روی بدون پخت (شکل۱–الف)، نشان می دهد چهار پیک مربوط به صفحات (۰۰۲)، (۱۰۰)، (۱۰۱) و (۱۰۲) با کارت استاندارد (JCPDS no.01-087-0713) مربوط به فلز روی، مطابقت دارد و منطبق با ساختار بلوری تنگ پکیده شش گوشی(HCP) می باشند. طیف پراش اشعه ایکس لایه های بازپخت شده در دمای C° ۷۰۰ و بازه زمانی متغیر یک تا پنج ساعت، پیک هایی که در محدوده ی ۴ تا ۷۰ درجه (برحسب θ۲) داده شده، تمام پیک های مربوط به کارت استاندارد (JCPDS no.36-1451) را نشان می دهد. نتایج این لایه ها حاکی از این است که پخت لایه های تهیه شده باعث تشکیل لایه های نازک اکسید روی شده است. شفافیت لایه های پخت شده در مقایسه با لایه بدون پخت نیز قابل توجه است. طیف پراش اشعه ایکس لایه بازپخت شده در دمای C° ۷۰۰ و زمان باز پخت پنج ساعت (شکل۱–و)، حاکی از تشکیل اکسید روی تقریبا خالص با شدت پیک هایی به مراتب بالاتر از بقیه لایه های نازک تهیه شده است.

اندازه ذرات و کرنش شبکه:

روش شرر: با استفاده از فرمول دبای-شرر، متوسط اندازه نانوذرات اکسید روی محاسبه شد. رابطه شرر، وابستگی اندازه ذرات به گستردگی و پهن شدن خطوط پراش را به صورت رابطه ۱ نشان می دهد [۵]: $D = \frac{k\lambda}{\beta\cos\theta}$

که در آن، k ثابت شرر برابر با مقدار ۸۰٬۹ طول موج پرتو ایکس (برای تابش Cu Ka برابر با ۱/۵۴۰۴۶ آنگستروم)، β پهنای پرتو در نصف

شدت پرتو افکنی ماکزیمم برحسب رادیان و D اندازه ذرات برحسب نانومتر می باشد. نتایج محاسبه اندازه ذرات، در جدول ۱ خلاصه شده است.



روش ویلیامسون-هال: یکی از ایرادهای روش شرر این بود که پهن شدگی پیک ها را تنها به اندازه دانه ها مربوط می کرد در حالی که مطالعات نشان می داد پهنای پیک علاوه بر اندازه دانه به کرنش های شبکه ای هم مربوط است. ویلیامسون و هال اندازه دانه و کرنش های درون شبکه ای را عامل پهن شدگی پیک های حاصل از پراش پرتو ایکس معرفی کردند. براساس تئوری ارائه شده توسط ویلیامسون- هال عرض پیک در نصف شدت بیشینه تابعی از اندازه ذرات و هم چنین کرنش های درون شبکه ای است.

$$\beta = \beta_S + \beta_D \tag{(Y)}$$

β_S و β_D به ترتیب پهن شدگی پیک بر اثر اندازه دانه و کرنش های شبکه ای است. استوکس و ویلسون حد بالای کرنش شبکه را به صورت زیرتعریف کردند:

$$\varepsilon = \frac{\Delta d}{d} = \frac{\beta_s}{4\tan\theta} \tag{(*)}$$

تغییر نسبی فاصله ی صفحات بلوری یا کرنش شبکه است. با $\frac{\Delta d}{d}$ θ تغییر نسبی فاصله ی صفحات بلوری یا کرنش شبکه است. با θ توجه به روابط ۱ و ۳، اندازه دانه ها با $\frac{1}{\cos\theta}$ و کرنش با $\frac{1}{\tan\theta}$ ، که θ زاویه براگ است، متناسب است. با قرار دادن روابط ۱ و ۳ در ۲ داریم:

$$\beta = \frac{k\,\lambda}{D}\cos\theta + 4\varepsilon\,\tan\theta\tag{(f)}$$

$$\beta\cos\theta = \frac{k\lambda}{D} + 4\varepsilon\sin\theta \tag{(a)}$$

رابطه ی ۵ از ضرب کردن طرفین رابطه ی ۴ در $\cos\theta$ ، حاصل شده است [۹]. نمودار ($\beta\cos\theta - 4\sin\theta$) برای نانوذرات لایه ی نازک روی بدون پخت و لایه های نازک اکسید روی بازپخت شده در دمای 2° ۰۰۷ و بازه زمانی متغیر یک تا پنج ساعت، در شکل ۲ نشان داده شده است. با برازش خط برای داده های نمودار، اندازه ذرات و کرنش شبکه را می توان به ترتیب از مقدار عرض از مبداء و شیب خط برازش شده محاسبه کرد. محاسبات اندازه ذرات D و کرنش شبکه 3 نمونه ها از روی خط برازش شکل ۲، در جدول ۱ آمده است.

جدول۱ : پارامترهای هندسی نانو ذرات روی بدن پخت و اکسید روی سنتز شده در دمای °C ۷۰۰ و مدت زمان متغیر یک تا پنج ساعت

SEM	روش ويليامسون-هال		روش شرر	
اندازه ذرات	کرنش شبکه ٤	اندازه ذرات	اندازه ذرات	نمونه
D (nm)	(۳-۱۰× واحد)	D (nm)	D (nm)	
۳۵	• /۵	۳۷	378	لايه نازک روي
۳۱	۵/.	۲۲	۲۸	۱h
۲۵	• 8	۳.	٣٢	۲h
١٩	٠/٢	74	۲۳	۳h
۲۳	1/1	١٧	٢٣	۴h
۲۰	١/٢	١٧	۲۲	۵h

تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM: این تصاویر یکی از بهترین راه های بررسی مورفولوژی نمونه مانند اندازه، شکل و نحوه قرارگیری ذرات در سطح جسم است. شکل ۳ تصاویر بیانگر این نمونه های مورد بررسی را نشان می دهد. این تصاویر بیانگر این موضوع می باشد که نانو ذرات سنتز شده، کروی شکل بوده و از نظر اندازه نسبتا یکنواخت می باشند. لایه بازپخت شده در مدت زمان یک ساعت که از لحاظ شکل، بیشتر ذرات به شکل ساختار بلوری تنگ پکیده شش گوشی(HCP) سنتز شده است و ذرات نانو در سطح، به دلیل کوچکی بیش از حد، به صورت توده تشکیل شده اند. محاسبات میانگین اندازه نانو ذرات سنتز شده روی و اکسید روی طبق تصاویر SEM در محدوده طولی ۹۰–۱۵۰ نانومتر در جدول ۱ گزارش شده است.



شکل ۲ : آنالیز ویلیامسون-هال نانو ذرات لایه نازک روی و لایه های نازک اکسید روی



شکل۳ : تصاویر SEM نمونه های: الف) بدون پخت و باز پخت شده در زمان: ب)۱ساعت، ج) ۲ساعت، د) ۳ساعت، ه) ۴ساعت و و) ۵ساعت

حاصل از تصاویر SEM، روش شرر و آنالیز ویلیامسون-هال با یکدیگر هم خوانی بسیار خوبی دارند.

مرجعها

- [1] C.F.Klingshirn, B.K.Meyer, A.Wagg A.Hoffman and J.Geurts;
 "Zinc Oxide"; *Springer*, (2010).
- [Y] C. He, T. Sasaki, Y. Shimizu, N. Koshizaki; "Synthesis of ZnO nanoparticles using nanosecond pulsed laser ablation in aqueous media and their self-assembly towards spindle-like ZnO aggregates"; Appl. Surf. Sci. 254 (2008) 2196–2202.
- [r] Z.W. Li, W. Gao; "Growth of zinc oxide thin films and nanostructures by wet oxidation"; *Thin Solid Films*. 515 (2007) 3323–3329.
- [*] T. Ungár; "Microstructural parameters from X-ray diffraction peak broadening"; Scr. Mater. 51 (2004) 777–781.
- [۵] B.D. Cullity, S.R. Stock; "Elements of X-ray diffraction, 3rd edition"; Prentice Hall. (2001).
- [9] A. Khorsand Zak, W.H. Abd. Majid, M.E. Abrishami, R. Yousefi, "X-ray analysis of ZnO nanoparticles by Williamson-Hall and size-strain plot methods"; *Solid State Sci.* 13 (2011) 251–256.
- [V] V.D. Mote, Y. Purushotham, B.N. Dole; "Williamson-Hall analysis in estimation of lattice strain in nanometer-sized ZnO particles"; (2012) 2–9.
- [A] C. Suryanarayana, M.G. Norton; "X-ray Diffraction: A Practical Approach"; *Microsc. Microanal.* 4 (1998) 513–515.
- [9] G.K. Williamson, W.H. Hall; "Discussion of the Theories of Line Broadening"; Acta Metall. 1 (1953) 22.

نتيجه گيرى

تغییر زمان باز پخت به عنوان یک عامل تاثیر گذار در تهیه لایه های نازک اکسید روی با کیفیت بالا مطرح می شود. مطالعه طیف پراش پرتو ایکس لایه ها با تغییر زمان باز پخت، نشان می دهد که لایه های اکسید روی سنتز شده، دارای ساختار بلوری هگزاگونال ورتزایت می باشند. طیف پراش پرتو ایکس لایه باز پخت شده در دمای 2° ۰۰۷ و زمان باز پخت پنج ساعت، حاکی از تشکیل اکسید روی تقریبا خالص با شدت پیک هایی به مراتب بالاتر از بقیه لایه های نازک تهیه شده است. به علاوه باز پخت لایه نازک به مدت یک ساعت به تشکیل ذرات با ساختار بلوری تنگ پکیده شش گوشی(HCP) منجر می شود و ذرات نانو در سطح، به دلیل نمونه ها تشکیل نانو ذرات کروی تایید می شود. هم چنین، کرنش شبکه تا مدت زمان باز پخت سه ساعت کاهش می یابد، اما با افزایش میزان اکسید شدن نانو ذرات ناشی از افزایش زمان